



## Žarko Lazić

Rukovodilac laboratorije za MEMS



**Adresa:** Centar za Mikroelektronske tehnologije, Institut za Hemiju, Tehnologiju i Metalurgiju, Univerzitet u Beogradu, Njegoševa 12, 11000 Beograd, Srbija

**Telefon:** +381 11 2630 757

**Fax:** +381 11 182 995

**E-mail:** [zlazic@nanosys.ihtm.bg.ac.rs](mailto:zlazic@nanosys.ihtm.bg.ac.rs)

**Kratka biografija:** Žarko Lazić je rođen 1959. godine u Beogradu, Srbija. Diplomirao je 1984. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Tehnička fizika. Angažovan je u oblastima planarne tehnologije i poluprovodnički senzori, u razvoju i metodama karakterizacije poluprovodničkih naprava. Objavio je preko 40 radova, od toga 5 u međunarodnim časopisima. Radi kao rukovodilac laboratorije za planarnu tehnologiju.

**Profesionalna dostignuća:** Dizajn i izrada komercijalnih senzora pritiska SP-6 i SP-12 koji su montirani u nekoliko postrojenja Elektroprivrede Srbije (EPS), vodovoda i Srbijagasa. Dizajn i izrada funkcionalnih modela aktuatora na bazi promene faze.

### Najznačajniji Međunarodni:

- projekti:** **2005 – 2008** Micro-nano cantilever based detection of small electromagnetic forces, SCOPES IB 7320-110923, Swiss National Science Foundation.  
**2008 – 2011** Reinforcement of Regional Microsystems and Nanosystems Centre REGMINA, Proj. No. 205533, 7th Framework Programme, European Union.  
**2013 – 2015** Phase Change Actuator, Scientific Partner ACMIT, Austria.  
**2015 –** CellFOS-Optofluidic Platform, Scientific Partner ACMIT, Austria.

### Nacionalni:

- 2003 – 2004** Mikrosistemske i nanosistemske tehnologije za senzore i optoelektroniku IT.1.04.0062.B, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije.  
**2005 – 2007** Mikro i nanosistemske tehnologije, strukture i senzori TR-6151B, Ministarstvo nauke Republike Srbije.  
**2008 – 2010** Mikrosistemske, nanosistemske tehnologije i komponente TR-11027, Ministarstvo za nauku Republike Srbije.  
**2011 – 2016** Mikro, nano-sistemi i senzori za primenu u elektroprivredi, procesnoj industriji i zaštiti životne sredine – MiNaSiS TR 32008, Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije.

### Izabrane Radovi u časopisima

- publikacije:** 1. M. M. Smiljanić, V. Jović, **Ž. Lazić**, "Maskless convex corner compensation technique on a (100) silicon substrate in a 25 wt % TMAH water solution", Journal of Micromechanics and Microengineering Vol. 22, No. 11, 2012 DOI:10.1088/0960-1317/22/11/115011  
2. M. M. Smiljanić, B. Radjenović, M. Radmilović-Radjenović, **Ž. Lazić**, V. Jović, "Simulation and experimental study of maskless convex corner compensation in TMAH water solution", Journal of Micromechanics and Microengineering Vol. 24, No. 11, 2014 doi:10.1088/0960-1317/24/11/115003

### Radovi sa konferencija

- Z. Đurić, M. M. Smiljanić, K. Radulović, **Ž. Lazić**, "Boron Redistribution During SOI Wafers Thermal Oxidation", Proc. 25th Internat. Conf. on Microelectronics MIEL, Belgrade, 14-17 May 2006, vol. 1, pp. 333-336
- D. M. Todorović, B. Cretin, Y. Q. Song, M. M. Smiljanić, **Ž. Lazić**, K. Radulović, "Photothermal Vibration Spectra of Square Diaphragm with Boss for Low-Pressure Sensor", Proc. 26th Internat. Conf. on Microelectronics MIEL 2008, Niš, Serbia, 11-14 May 2008, Vol. 2, pp. 325-328, ISBN 978-1-4244-1882-4
- Z. Đurić, I. Jokić, M. Frantlović, D. Ranđelović, D. Vasiljević-Radović, M. M. Smiljanić, **Ž. Lazić**, "Fabrication and Characterization of AFM Golden Microcantilevers and Measurement of Small Electromagnetic Forces", Proc. 26th Internat. Conf. on Microelectronics MIEL 2008, Niš, Serbia, 11-14 May 2008, Vol. 2, pp. 363-366, ISBN 978-1-4244-1882-4
- Z. Đinović, M. Tomić, L. Manojlović, **Ž. Lazić**, M. M. Smiljanić, "Non-contact Measurement of Thickness Uniformity of Chemically Etched Si Membranes by Fiber-Optic Low-Coherence Interferometry", Proc. 26th Internat. Conf. on Microelectronics MIEL 2008, Niš, Serbia, 11-14 May 2008, Vol. 2, pp. 321-324, ISBN 978-1-4244-1882-4

5. **Ž. Lazić**, M. M. Smiljanić, M. Rašljčić, I. Mladenović, K. Radulović, M. Sarajlić, D. Vasiljević-Radović, "Wet isotropic chemical etching of Pyrex glass with masking layers Cr/Au", Proc. 1st Conf. IcETRAN, Vrnjačka Banja, June 2 – 5, 2014, pp. MOI1.1.1-4, ISBN 978-86-80509-70-9, Best Section Paper Award: MO
  6. **Ž. Lazić**, M. M. Smiljanić, M. Rašljčić, "Glass Micromachining with Sputtered Silicon as a Masking Layer", Proc. 29th International Conference on Microelectronics MIEL 2014, Niš, Serbia, May 12-15, pp. 175-178, ISBN 978-1-4799-5295-3
-